# MOLDING METHOD IN MAGNETIC FIELD OF RARE EARTH MAGNET AND DEVICE THEREOF

patent number:

JP61154118

publication date:

1986-07-12

Inventor:

YONEYAMA TETSUTO; SEKO YASUJI

Applicant:

**TDK CORP** 

Classification:

\_ international:

H01F41/02; H01F41/02; (IPC1-7): H01F41/02

- european:

H01F41/02B

Application number:

JP19840273835 19841227

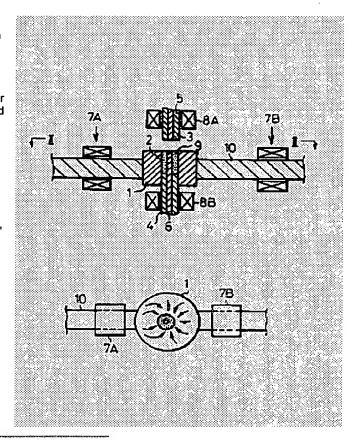
priority number(s):

JP19840273835 19841227

Report a data error here

#### Abstract of JP61154118

PURPOSE: To obtain radial by oriented magnet by making a coil magnetized magnetic field impression generate pulse radial repulsion magnetic field. CONSTITUTION: Member powder 9 is put in a motar 1 at the state that a lower punch 4 is inserted into the mortar 1 and a center bar 6 is projected, and an upper punch s removed to near-by the upper face of the mortar 1, then pulse current is conducted to a coil 8A, 8B for magnetized magnetic field impression. Magnetized magnetic field, which is stronger than at least IHc of powdery body, is impressed, then member powder 9 is magnetized previously. At this time, generation of large magnetic field is facilitated by means that one way magnetic field generation measure, which 8A, 8B are designated as hemimorphites by a hollow coil. After magnetization of the member powder 9 power, conduction to the coil 8A, 8B for magnetized magnetic field impression is stopped and the member powder 9 lowering an upper punch 3 is subjected to perform compress-forming at the state that a coil 7A, 7B for oriented magnetic field impression is conducted respectively, and oriented magnetic field in comparative weak radial direction less than IHc of the member is impressed. Thereby, a ring-state form, in which anisotrophic direction is changed to radial direction, is obtained.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# <sup>®</sup> 公開特許公報(A) 昭61-154118

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和61年(1986)7月12日

H 01 F 41/02

7227-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

の発明の名称 希土類磁石の磁場中成型方法及び装置

②特 願 昭59-273835

②出 願 昭59(1984)12月27日

⑦発 明 者 米 山 哲 人 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

⑫発 明 者 瀬 古 保 次 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

⑪出 願 人 ティーディーケィ株式 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

砂代 理 人 弁理士 青木 朗 外4名

明細 有

1. 発明の名称

希土類砥石の磁場中成型方法及び装置

## 2. 特許請求の範囲

1. 希土類磁石の磁場中成型方法において、

前記希土類磁石の材料となる粉末の集合体に対して放射方向に印加されるペルス磁場を同極対向 磁化コイルにより発生して散粉末を着磁し、この 着磁と同時に前記材料の集合体を成型するか、あるいは着磁後前記粉末に放射状配向磁場を印加し た状態で成型することを特徴とする放射状配向希 土類磁石の磁場中成型方法。

2. 冥通穴を有する日とその貫通穴に嵌入可能 な上パンテおよび下ペンチと日の上下に着磁磁界 印加用パルス磁場発生コイルと、任意の位置に配 置された配向磁界印加用磁場コイルとを備えたと とを特徴とする希土類磁石の磁場中成型装置。

# 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高性能の磁気特性を有する希土類磁石

の磁場中成型法なよび装置に関する。

SmCo<sub>5</sub>, Cu 添加 Sm<sub>2</sub>Co<sub>17</sub>, Nd - Pe - B系のような磁石は従来のフェライト、アルニコ磁石と比較して高い性能を有するため広い分野で使われるようになってきている。との希土類磁石の各種用途への応用に際して、磁石の異方性化の方向が単一の方向のものばかりでなく特殊な分布をもった磁石の要求も多い。希土類磁石の高性能な磁気特性を各種用途で発揮させるためにそのような特殊配向要請に答える必要がある。例えば、特殊な磁化分布のうち、異方性化の方面がいわゆるラッアル(放射状)分布となっているリング状磁石は、ステッピングモータ、リニアアクテュエータ、磁気カップリング等への応用に際し優れた性能を示すと期待されている。

## (従来の技術)

しかしながら、ラジアル分布等の特殊な磁化分 布を有する磁石は、製造方法上困難な点があり、 実用化に制限があった。

従来、とのような点を改良するために、希土類

#### (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上述の装置では特に高保磁力を 有する粉末、例えばプラスチック磁石用として Cu 添加 2 - 17 系希土類コベルト系磁石のような 時効後, He が通常の焼結磁石における磁場配向時

えると、該磁場が集合体内で反接して集合体外に 洩れる際に、集合体には極めて大きな着磁磁場が 生じることになる。このような逆極対向磁化コイ ルを集合体の軸線上に配置すると反扱磁場は該集 合体に対して放射方向に流れるようになる。

本発明方法では上記放射方向の反殺磁場を印加 しながら成型を行うと放射状配向磁石が着磁工程 で得られる。この方法では着磁のために大出力磁 化コイルが必要になるが、特に配向工程を着磁と 別工程で行う必要はなくなる。

また、本発明方法では着磁後、集合体を配向磁場中で成型すると弱い配向磁場中で放射状配向磁石を製造することができる。この方法では集合体を容器または型から取り出した後に成型してもよく、あるいは数型内で集合体で成型を続けて行ってもよい。

本発明に係る装置は、型を用いて上記粉末をリング形状の集合体として保持し、そして着磁磁界印加用コイルと配向用コイルを用いて放射方向異方性希土類磁石を製造する装置であって、その要

の 5 倍以上となるような状態で使用される粉末の 場合、極めて不十分な結果しか得られない。

本発明者らは、このような高iHcを有する磁石 粉末のラジアル配向について鋭意検討した結果、 着磁磁束がリング状粉体内を軸線方向に流れるよ うな着磁方法では材料のiHcに対して着磁による 磁化強度が十分でなくひいては配向性が不十分に なることを見出した。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明者等は上述の問題点を解決すべく着磁磁界印加法について研究した結果、着磁磁界印加用コイルにペルス状放射上反撥磁場を発生させた場合のみ十分な着磁磁場ひいては配向度が得られることがわかり本発明に至ったものである。

この知見を具体化した本発明方法では、成型,配向,無処理, #ンディング等の適当な処理を施 こされて希土類磁石の材料となる粉末を適当なま とまりを有する集合体としての形状を保持し、例 えば環状または円盤形状を有するかかる集合体に 対して同極対向磁化コイルより発生する磁場を加

旨とするところは、貫通穴を有する臼とその貫通 穴に嵌入可能な上ペンチをよび下ペンチと臼の上 下に着磁磁界印加用ペルス磁場発生コイルと、任 意の位置に配置された配向磁界印加用磁場コイル とを備えたことを特徴とすることにある。

#### (作用)

特にリング状配向磁石製造用型内で着磁を行う場合は、上記した粉末の集合体の周囲に存在する強強性の型部材が酸粉末より透磁率が高いことが多いために、着磁の磁束は型部材を流れ易い。ところが本発明の方法によると、磁場が反殺し合うために、強磁性の型部材が粉末を強力に着磁力に発磁は粉末を一層強力に着磁力を有別に反接磁場は粉末を一層強力に着磁石材料を有効に着磁しひいては配向度を高めるために本発明方法は有用性が高いと含える。

( 寒施例 )

以下、本発明の実施例を図面に従って説明する。 第1図および第2図は希土類コパルト磁石の磁 場中成型装置の概略構成を示す。との図において、 P.1の中心部には円柱状の貫通穴2が形成されて おり、との貫通穴2に上方より飫合するように上 **ルンチ3が上下移動自在に配置され、前記貫通穴** 2 に下方より嵌合するように下ペンチ 4 が上下移 動自在に配置される。前記上ペンチ3の中心には 磁性体5が挿入され、下ペンチ4の中心には中棒 6 が上下移動自在に設けられる。ととで、上ペン チ3及び下ペンチ4は非磁性材であり、白1、磁 性体 5、中棒 6 及び外部ローク10は飽和磁束密 度 B a ≥ 10 KG の磁性材で構成される。前配日1 の近傍には、外部ヨーク10を通して配向磁界印 加用コイル 7 A , 7 B が同極で相対するように配 設され、前配上パンチ3及び下パンチ4の近傍で なおかつ白1の上下面近傍には着磁磁界印加用ペ ルスコイル8A,8Bが配設される。

配向磁界印加用コイル7 A , 7 B による磁界は

れるため貫通穴2には2~3 KOeの極めて弱い着 磁磁界しか発生しない。しかしながら同極空心コ イル8 A · 8 B は、小さな磁場しか発生しないが、 反発放射状磁場を発生させるので白1、磁性体5、 中棒6が瞬間的に放射状方向に磁化され、中棒6 と白の間のキャピティーに、予想に反してかなり 大きな着磁磁場が発生する。

材料粉末9を着磁後、着磁磁界印加用コイル 8 A , 8 B への通電を停止し、配向磁界印加用コイル7 A , 7 B に夫々通電して材料の IHc 以下の 比較的弱いラジアル方向の配向磁界を印加した状態で上ペンチ3を下降させ材料粉末9を圧縮成型 する。この結果、異方性化の方向がラジアル方向 となったリング状の成型体が得られる。

第3図は、材料粉末9(第1図)として8m25.5 多、Cu8%、Fe15%、Zr1.5%、Co50%の組 成かよび iHe=7KOeの保磁力を有するものを使用 し、外径27m、内径23m、高さ12mのラジ アル配向リングを成型した場合の配向磁界強度と 配向度、残留磁化(Br) および最大エネルギー積 第2図に矢印で示すように白1内に充填される材料粉末9に対してラジアル方向に加わるものであり、前記白1、磁性体5、中棒6及び外部ョークを磁性材で構成したのでラジアル方向の磁界を効率よく発生できるようになっている。しかしながら通常得られる配向磁場の絶対値は低い。

以上の構成において、本発明のラジアル配向希 土類磁石の磁場中成型は次のようにして行う。ま ず、日1内に下ペンチ4を嵌入させかつ中棒6を 突出させた状態で材料粉末9を白1の貫通穴2に 入れる。

次いで、上ペンチを白1の上面附近に移動させ、 着磁磁界印加用コイル8A,8Bにペルス電流を 通電する。得られるペルス放射状磁場を利用し、 少なくとも粉体のIHe以上の強力な着磁磁界を印加し、材料粉末9を予め着磁する。この場合、空 心コイルで8A,8Bを異極とする1方向発生磁 場発生手段とすると大磁場の発生が容易である。 しかし、この場合、白1かよび磁性体5かよび中 棒6が存在すると、磁束の大半が強磁性体中を流

((BH)<sub>m</sub>)との関係を示すグラフである。この図にかいて、曲線 A は着磁磁界を印加しないでラジアル配向した場合、曲線 B は磁場中成型前に異極を対向させた着磁コイルの1方向パルス磁界にて、C は反発放射状パルス磁場にて材料粉末9を着磁後磁場中成型した場合の特性を示す。ただし、図中の配向度は1方向配向による配向磁界強度12 KO→の配向を1として表わしてある。この場合、A,Bでは0.5~0.6 程度の配向度しか得られない。しかしながら本発明によるCの放射状着磁磁場を用いた場合、配向度約90多と極めて顕著な効果を示している。

# (発明の効果)

従来高配向が困難であった保磁力の高い材料粉末に本発明方法を適用するとラジアル配向のマグネットが得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明方法を実施するための装置の一 実施例を示す部分断面図、

第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線平面図に配向磁界の

方向を借入れた図面、

第3図は配向磁界と (BH)<sub>max</sub>、 Br、配向度との 関係を示すグラフである。

1 … 白、 2 … 貫通孔、 3 , 4 … ペンチ、 6 … 中 ・ 棒、 7 A , 7 B … 配向磁界印加用コイル、 8 A , 8 B … 常磁磁界印加用コイル。

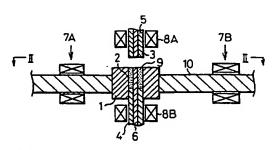
特許出顧人

ティーティーケイ株式会社

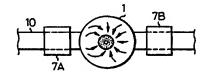
特許出顧代理人

升理士 青 木 射 升理士 西 舘 和 之 升理士 村 井 卓 雄 升理士 山 口 昭 之 升理士 西 山 雅 也

第1 図



第 2 図



第 3 図

